(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-198197

(43)公開日 平成6年(1994)7月19日

(51) Int.Cl.5

識別記号 庁内整理番号

3 1 1 C 8017-4G

B 0 1 J 35/04 F01N 3/28

ZAB Z

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数3(全 4 頁)

(21)出願番号 特願平4-360864

(22)出顧日 平成4年(1992)12月29日 (71)出願人 000222484

東洋ラジエーター株式会社 東京都渋谷区桜丘町31番2号

(72) 発明者 山中 旭

東京都渋谷区松丘町31番2号 東洋ラジエ

ーター株式会社内

(72)発明者 波辺 雅己

東京都渋谷区桜丘町31番2号 東洋ラジエ

ーター株式会社内

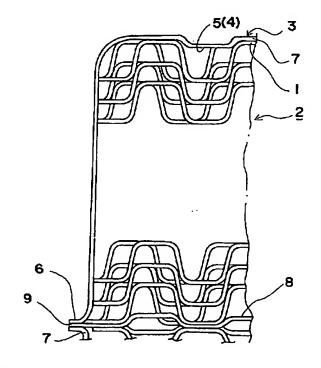
(74)代理人 弁理士 窪田 卓美

(54) 【発明の名称】 排気ガス浄化用触媒担持体

(57)【要約】

【目的】 担持体のコア部を同一形状のフィンで構成 し、且つ互いにろう付けすることなくフィンを積層し量 産性のある排気ガス浄化触媒担持体を提供すること。

【構成】 同一形状の多数のオフセットフィンの積層体 を有し、夫々のオフセットフィンは波の稜線方向に互い に隣合う各波列の位相がずれて、多数の台形波が配置さ れるように夫々の金属板が曲折及び切り起こし形成され たものである。そして、オフセットフィンの台形波の各 開口に、隣接するオフセットフィンの台形波の各頂部が 嵌着され、その積層体外周が筒状のケーシングで被蔽さ れる。そして、ケーシングと積層体との間が固定手段に より固定されたものである。



7

【特許請求の範囲】

【請求項1】 夫々金属板が曲折及び切り起こされて、 波の稜線方向に隣り合う各波列の位相がずれて多数の台 形波が配置された多数の同一形状のオフセットフィン1 を有し、一方の前記オフセットフィンの前記台形波の各 台形凹部に、隣接する他方の前記オフセットフィンの台 形波の各台形頂部が嵌着するようにして積層された積層 体2と、その積層体2の外周を被蔽する筒状のケーシン グ3と、そのケーシング3と前記積層体2との間を固定 する固定手段4とを具備し、前記積層体2の前記稜線方 向に排気ガスが導かれるように構成され且つ、前記積層 体2を構成する夫々の前記オフセットフィン1 どうしは 互いにろう付けされることがないことを特徴とする排気 ガス浄化触媒担持体。

請求項1において、前記ケーシング3の 【請求項2】 内面に複数の凸部5が設けられ、その凸部5が前記積層 体2の最外側に位置された前記オフセットフィン1の波 の凹部に嵌着するように構成された前記固定手段4を有 する排気ガス浄化触媒担持体。

口縁にフランジ部6を有する一対の溝状金属板7が前記 夫々の開口縁を逆向きに重ね合わされて前記ケーシング 3が構成され、前記一対の溝状金属板7の対向する前記 フランジ部6間に前記積層体2の中央部に突設されたフ ランジ状縁部9が挟持された排気ガス浄化触媒担持体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、各車両のエンジンから 排気される排気ガスの浄化触媒物質を担持する担持体に 関し、より詳しくは同一形状の台形波状オフセットフィ 30 ンを用い、ろう付けなしに、担持体主要部を構成するこ とにより、量産性の優れたものとした担持体に関する。 [0002]

【従来の技術】平板と波形金属板とを積層すると共に、 それらの間をろう付けすることなく互いに一体化したも のとして、特公昭60-27806号公報記載の排気浄 化用触媒担持体が存在する。又、平板と波形金属板とを 渦巻き状に形成したものとしては、特開平1-3065 2号公報のメタル触媒担持体或いは特開平3-1783 36号公報記載の排気浄化用触媒コンパータが存在す 40 る。これらは、何れも波形金属板の頂部に係合部を設 け、その係合部に整合する位置で、平板に係止部を設 け、両者の嵌着により積層体を構成し、平板と波形金属 板とを一体化して、相互に位置ずれしないように構成し たものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】このような触媒担持体 は、波形金属板と平板との2種の金属板を交互に重ね合 わせ且つ、夫々の係合部及び係止部を整合させる必要が ガスの流体抵抗を考慮し極めて小さなものとせざるを得 ない。すると、この波形金属板と平板との係合が極めて 面倒であり、使用中に高温の排気ガスの風圧や熱膨張そ の他により係合部が外れてしまう恐れがある。そのた

め、実用に供せられるこのような非ろう付け型の触媒担 持体は従来使用されていなかった。そこで本発明は同一 形状の台形波状オフセットフィンを用い、それらを互い に重ね合わせることにより、恰も茶碗を重ね合わせるが 如く互いに嵌着しつつ、オフセットなるが故にフィンの 平面方向にも互いに係止できる積層体とし、量産性ある

触媒担持体を提供することを目的とする。そして、その 目的達成のために次の構成をとる。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の排気ガス浄化用 触媒担持体は、夫々金属板が曲折及び切り起こされた多 数の同一形状のオフセットフィンを有する。このオフセ ットフィンは波の稜線方向に隣合う各波列の位相がずれ て、多数の台形波が配置されたものである。そして、一 方の前記オフセットフィンの前記台形波の各台形凹部 【請求項3】 請求項1又は請求項2において、夫々開 20 に、隣接する他方の前記オフセットフィンの台形波の各 台形頂部が嵌着するようにして積層体を構成する。そし て、その積層体の外周を筒状のケーシングで被蔽し、そ のケーシングと積層体との間を固定手段4により固定す る。そして、積層体2の稜線方向に排気ガスが導かれる ように形成され且つ、積層体2を構成する夫々のオフセ ットフィンどうしは互いにろう付けされないことを特徴 とする。

[0005]

【作用】本発明の触媒担持体のコア部を構成する積層体 は、多数の台形波を配置した同一形状のオフセットフィ ンが積層され且つ、互いに嵌着することにより、積層方 向に等間隔の隙間を形成し、稜線方向に互いに相対移動 しないように構成されたものであるためろう付けが不要 となる。従って、異なった種類の部品点数が極めて少な い量産性の高い担持体となる。そして、排気ガスは各オ フセットフィンの波の稜線方向に導かれ、フィン表面に 担持される触媒により浄化される。この時、髙温の排気 ガスによって各フィンに熱膨張が生じるが、この担持体 はフィンどうしが互いにろう付けされないと共に、全て 台形波で形成されているため、その熱膨張を極めて円滑 に吸収し、耐久性の高い担持体となる。

[0006]

【実施例】次に、図面により本発明の排気ガス浄化用触 媒担持体の実施例を説明する。図1は本発明の排気ガス 浄化用触媒担持体の要部正面図であり、図2は同担持体 の斜視略図ある。又、図3は同担持体の積層体を構成す るオフセットフィンの一例を示す要部斜視図である。こ の排気ガス浄化用触媒担持体は、図1及び図2に示す如 く多数のオフセットフィン1からなる積層体2と、それ あった。特に、波形金属板の頂部に設ける係合部は排気 50 らの外周を被蔵する筒状のケーシング3を具備する。そ .3

して、積層体2の積層方向の向きは、ケーシング3の中央に配置された介装板8を中心として上下対称の向きに配置されている。オフセットフィン1は図3に示す如く、夫々金属板が曲折及び切り起こしされ、多数の台形波が形成されると共に、波の稜線方向に隣り合う各波列の位相が半ピッチずれている。このようなオフセットフィン1を積層し、一方のオフセットフィンの台形波の各台形凹部に、隣接する他方のオフセットフィンの台形波の各台形頂部が嵌着するように構成される。すると、図1に示す如く各オフセットフィン1が等間隔で積層され 10 ス

【0007】次に、ケーシング3は夫々開口録にフラン ジ部6を有する一対の滯状金属板7の各開口縁が逆向き に重ね合わされたものである。そして、一対の滯状金属 板7の対向するフランジ部6間に介装板8のフランジ状 縁部9が挟持される。この介装板8は、オフセットフィ ン1の台形波の台形凹部に嵌着する振幅の小さな波形板 からなり、中央に対して上下に台形状波が形成される。 この介装板8のフランジ状縁部9は、先に述べた如く一 対の溝状金属板7のフランジ部6に挟持され、一例とし 20 てこれらの間が溶接又はろう付け或いはピス止め等によ り固定される。なお、介装板8の代わりに、図4の如く 中央に配置されたオフセットフィン1の縁部を突出さ せ、それを一対の溝状金属板7のフランジ部6に挟持さ せてもよい。又、ケーシング3の上下両面にはその内面 側に凸部5が突設され、その凸部5が積層体最外側に位 置するオフセットフィン1の台形凹部に嵌着する。そに より、積層体2全体とケーシング3とが係止する。この ような凸部5は、ケーシング外面に図2に示す如く多数 設けられている。

[0008]

【変形例】本発明の触媒担持体のケーシング3の断面形状は、矩形状であっても円筒状であっても或いは楕円状であってもよい。それらの場合、その内周面に整合するようにオフセットフィンの積層体の外周が形成される。

[0009]

【発明の効果】本発明の触媒担持体は、同一形状のオフ セットフィンを積層してなると共に、各オフセットフィ ン間はろう付けされることがないため、製造容易で且 つ、触媒の抵持をオフセットフィンの全面に行うことが できる。即ち、ろう付け部分は触媒の担持をし難いが、 本発明のフィンは互いにろう付けされないため全面に触 媒を担持できる。又、同一形状のオフセットフィンを積 層することにより積層体を構成できるため、この点から も製造容易なものとなる。しかも、オフセットフィンは 夫々金属板が切り起こされて各波列の位相がずれている ため、複数のオフセットフィンが積層されることにより 互いに各列の台形部が噛み合い、積層体全体がろう付け なしに一体化し、使用中に各フィン相互間が平面方向に 分離することがない。そして、積層方向の一体化はケー シングにより行われる。又、本担持体の積層体はオフセ ットフィンからなると同時に、各フィン間にはろう付け がされていないから、高温の排気ガスによるフィンの熱 膨張を円滑に吸収できる。

【図面の簡単な説明】

20 【図1】本発明の触媒担持体の要部断面略図。

【図2】同担持体の斜視略図。

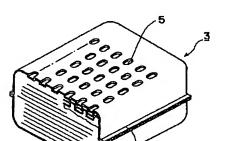
【図3】同担持体の積層体構成要素であるオフセットフィンの一例を示す斜視略図。

【図4】本発明の担持体の他の実施例の要部を示すもの。

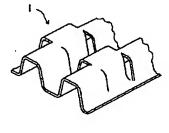
【符号の説明】

- 1 オフセットフィン
- 2 積層体
- 3 ケーシング
- 30 4 固定手段
 - 5 凸部
 - 6 フランジ部
 - 7 溝状金属板
 - 8 介装板
 - 9 フランジ状縁部

[図2]

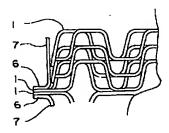


【図3】



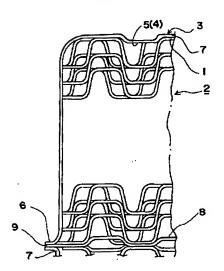
【図4】

٠٠٠



[図1]

(4)



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-198197

(43) Date of publication of application: 19.07.1994

(51)Int.Cl.

B01J 35/04 F01N 3/28

(21)Application number : **04-360864**

(71)Applicant: TOYO RADIATOR CO LTD

(22) Date of filing:

29.12.1992

(72)Inventor: YAMANAKA AKIRA

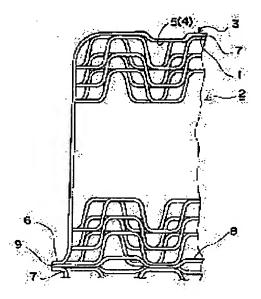
WATANABE MASAMI

(54) CATALYST CARRIER FOR PURIFICATION OF EXHAUST GAS

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a mass-productive carrier of a catalyst for purification of exhaust gas by laminating fins of same shape without brazing to form the core of the carrier.

CONSTITUTION: A laminated body 2 is obtd. by bending and cutting metal plates 7 into offset fins having lots of trapezoid waves and then arranging these fins 1 of same shape in the edge line direction of waves in such a manner that phases of adjacent waves are shifted. Each apperture of trapezoid wave of the offset fin 1 is engaged with the top part of trapezoid wave of the adjacent offset fin 1, and the peripheral of the laminated body 2 is covered with a cylindrical casing 3. The casing 3 and the laminated body 2 is fixed with a fixing means 4.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

03.12.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3334059

[Date of registration]

02.08.2002

[Number of appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Docket # 2-8 1179
Applic. #_____

Applicant: W. Maus, et al.

Lerner Greenberg Stemer LLP
Post Office Box 2480
Hollywood, FL 33022-2480
Tel: (954) 925-1100 Fax: (954) 925-1101